KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020020011617 A

number:

(43) Date of publication of application:

09.02.2002

(21)Application number: 1020000045017

(71)Applicant:

SAMSUNG SDI CO., LTD.

(22)Date of filing:

03.08.2000

(72)Inventor:

CHOI, YONG SU KANG, JEONG HO KIM, JONG MIN LEE, NAE SEONG

PARK, YEONG JUN

(51)Int. CI

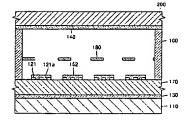
H01J 1/30

(54) MIC(METAL-INSULATOR-CARBON) TYPE FIELD EMISSION DEVICE USING CARBON NANOTUBES AND INSULATOR

(57) Abstract:

PURPOSE: A MIC(Metal-Insulator-Carbon) type field emission device using carbon nanotubes and insulators is provided, which can control an emission current easily by locating a gate electrode below a cathode.

CONSTITUTION: A mesh-grid(180) is inserted between a cathode(121) and an anode(140) to control the spreading of emission electrons due to an edge emission, and thus a color separation can be improved. The mesh-grid can prevent an electric



field of the anode from influencing on the cathode when a high voltage is applied to the anode to obtain a high brightness. According to the fabrication sequence of an under-gate structure, a gate is formed on a substrate and an insulation layer is placed on the gate, and then the cathode is formed on the insulation layer. After coating a mixed material of a carbon nanotube and a dielectric material along the cathodes or on a dot region where the cathodes are overlapped with the gates, a front substrate(200) and a rear substrate(110) are sealed in vacuum using a spacer(160).

© KIPO 2002

Legal Status

Date of final disposal of an application (00000000)

Date of registration (00000000)

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. 61.⁷ HD1J 1730 (11) 공개번호 특2002-0011617 (43) 공개일자 2002년02월08일

(21) 출원번호	10-2000-0045017
(22) 출원일자	2000년 08월 03일
(71) 출원인	삼성에스타OPO 주식회사 김순택
(72) 발명자	경기 수원시 팔달구 신동 575번지 최용수
	서울특별시판악구봉천7동296낙성대현대마파트202동1204호
	이내성
	서울특별시미포구대흥동241-12
	강정호
	서울특별사동대문구답십리1동478~118/5
	김종민
	경기도성남시분당구금곡동한라아파트305동1006호
	박영춘
(74) 대리인	경기도의왕시왕곡동593물곡아파트102동1501호 이영필, 조혁근, 이해영
실사평구 : 없음	

(54) 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 M 1 C형 전계 방출 조자

$\mathcal{L}^{\mathcal{Q}}$

본 발명은 저전압 전계 방출 물질인 탄소나노튜브를 이용하여 대면적의 평판 표시 소자를 구현하는데 사용될 수 있는 탄소나노튜브를 이용한 MIC형 전계 방출 소자(metal-insulator-carbon type:field emission device using carbon nanotubes)를 기재한다. 즉, 본 발명에 따른 카본나노튜브와 절면물질을 이용한 MIC 형 전계 방출 소자는 게이트가 음극(cathode)의 하단에 위치한 이른바 "under-gate"구조에 카본나노튜브와 접면물을 혼합한 페이스트를 음극상에 도포하여 카본나노튜브의 전자 방출원을 형성한 구조를 갖는다.

UHS

57

BAKE

도면의 간단한 설명

도 1은 증래의 키본나도튜브를 이용한 삼국구조 전계 방출 소자의 개략적 구조를 보여주는 수직 단면도. 도 2는 선 발명에 따른 카본나도튜브를 이용한 삼국구조 전계 방출 소자의 개략적 구조를 보여주는 수직 단면도.

도 3은 기존의 MIM (metal-insulator-metal)형 전자 방출원에서 찾을 후막의 에너지 밴드캡을 타타낸 다이어그램,

도 4a 및 도 4b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 MC형 전계 방출 소자의 제1실시 에 구조를 깨탁적으로 보여주는 수직 단면도 및 음극 상에 카본나노튜브와 절면물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도,

도 5a: 및 도 5b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 MIC형 전계 방출 소자의 제2설시 예 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도 및 음극 상에 카본나노튜브와 절면물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도,

도 6a 및 도 6b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노류보와 절면물을 이용한 세C형 전체 방출 소자의 제3실사 에 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도 및 음극 상에 카본나노튜브와 절면물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도이다.

그리고 도 7은 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 MIC형 전계 방출 소재의 제4실시에 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

1. 배면 기판

2. 음국

3. 게이트

3a. 개구부

4. 양극

5. 카본 나노 튜브

6. 스페이서

10. 전면 기판

11. 배면 기판

12. 음극

13. 別015

14. 양극

15. 키본 나노 튜브

16. 스페이저

17. 절연층

20. 전면 기판

110. 배면 기판

120. 음극

121, 음극

121a, 구멍

130. 게이트

140. 양극

150, 151, 152. 카본나노튜브 및 절연물 혼합 페이스트

160. 스페이서

170. 절면층

180. 메쉬 그리드

200. 전면기판

발명의 상세환 설명

발명의 목적

불명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 증례기술

본 발명은 저전압 전계 방출 물질인 탄소나노튜브를 이용하여 대면적의 평판 표시 소자를 구현하는데 사용될 수 있는 탄소나노튜브를 이용한 MIC항 전계 방출 소자(metal-insulator-carbon type field emission device using carbon nanotubes)에 관한 것이다.

도 1은 기존의 카본 나노 튜브를 이용한 삼국 구조 전계 방출 소자의 개략적 구조를 보여주는 단면도이다. 도시된 바와 같이, 기존의 카본 나노 튜브를 이용한 삼국 구조 전계 방출 소자는 스페이서 (6)를 사이에 두고 일정한 간격을 유지하면서 서로 대한하는 배면 기판(1) 및 전면 기판(10)이 구비되고, 이들 사이에 전자 방출원으로 카본 나노 튜브(5)가 도포된 음국(2), 게이트(3) 및 양국(4)을 구비하고 있다. 음국(2)들은 배면기판(1) 상에 스트라이프 상으로 나란하게 배치되어 있고, 양국(4)들은 음국(2)들과 교치하는 방향의 스트라이프 상으로 전면기판(10) 상에 나란하게 배입되어 있다. 양국(4)들은 음극(2)들과 교치하는 방향의 스트라이프 상으로 전면기판(10) 상에 나란하게 배입되어 있다. 양국(4)들이 음국(2)들과 대응하도록 나란하게 배치되어 있다. 음국(2)들과 게이트(3)들이 교치하는 지점들에는 각각 카본 나노 튜브(5) 및 개구부(3a)가 형성되어 있다. 즉, 교차점들의 음국(2) 상에는 전자 방출원으로 사용되는 카본 나노 튜브들이 도포되어 있고, 교차점들의 게이트(3) 즉 카본 나노튜브들에 대응하는 게이트 (3) 영역들에는 개구부(3a)들이 형성되어 있어 카본나노튜브(5)로부터 방출된 전지가 양국(4)으로 흐를수 있도록 한다.

이와 같이, 전계방출소자는 음극(cathode)와 양극(anode)으로 이루어진 이극 구조, 또는 이틀 전극을 사이에 케이트(sate)를 위치시킨 삼극교조의 형태로 음극(cathode)에서 방출되는 전자량을 제어하였다. 최근에는 탄소나노튜브의 출현으로 음극(cathode) 상에 형성되는 전자 방출용 팀으로 기존의 금속 팀(tip)에서 탄소나노튜브의 출현으로 음극(cathode) 상에 형성되는 전자 방출용 팀으로 기존의 금속 팀(tip)에서 탄소나노튜브를 적용하는 구조들이 사도되고 있다. 탄소나노튜브는 큰 증행비(aspect ratho)(>100 와 도체와 같은 전도성을 갖는 전기적 특성과 안정된 기계적 특성을 갖기 때문에 현재 여러 연구기관에서 시도되고 있는 전계방출소자의 팀으로 도포하는 재료로 각광받고 있는 선물질이다. 탄소나노튜브를 이용한 미국구조의 전자방출소자의 팀으로 도포하는 재료로 각광받고 있는 선물질이다. 탄소나노튜브를 이용한 미국구조의 전자방출소자는 현재 기존의 전형적 구조등으로 제작이 가능하다. 미국구조는 상대적으로 제작의 용이성은 있으나, 방출전류를 제어하는데 문제가 있어 동영상이나 다계조(gray-scale)의 영상을 살현하는데 머려움이 있다. 카본나노튜브를 이용한 삼국구조의 경우는 음극 바로 위에 게이트 전극을 배치하는 것과 그리드(grid) 형태의 금속 사트(metal sheet)를 배치하는 것을 고려할 수 있다. 전자의 경우는 게이트의 배치관계로 음극에 카본나노튜브를 접합시키는 머려움이 있고, 후자는 공정의 번거러움과 제어 건강이 증가하는 문제가 있다.

또한, 이러한 전계 방을 소지의 전자 방출원으로서 카보나노튜브를 미용하는 외에도 영국의 PFE 사에서는 금속 분말(metal powder)과 유전체 분말을 섞어 기존의 박막 구조와는 다른 후막의 MIM 구조를 갖는 천자 방출원을 음극 상에 형성한 전계 방출 소자를 제작하는데 성공하였다는 보고가 있다. 미러한 MIM형 전자 방출원 구조는 미국 특히 US 5,202,605(1993)호에 MIM cold-cathode electron emission elements 라는 제목으로 소개된 바 있으며, 논문으로는 'Hiroshi Adachi, 'Emission characteristics of metal-insulator-metal tunnel cathodes', J. Vac. Sci. Tech. B 14, 2093, 1996. 에 소개된 바 있다.

그러나 이러한 MM형 전자 방출원 역시 기존의 3전국형 전계 방출 소자의 전자 방출원으로서 음극 상에 형성하는데에는 공정이 어렵고 복잡하다는 단점이 있었다.

望智OI 01年277 可上 기全적 377

본 발명은 상기와 같은 문제점을 개선하고자 창안한 것으로, 게이트 전국을 음극 하단에 위치시켜 방출전류의 제대가 용미한 동시에 카본나도류보를 음극 상에 금속 대신 분말로된 카본나도류보와 절면물질을 이용한 씨(영 전계 방출 소지를 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 당정하기 위하여 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 접연물질을 이용한 MIC형 전계 방출소자는... 입정한 간격으로 서로 대항하도록 배치된 배면 기판 및 전면 기판; 상기 두 기판의 간격을 유지하면서 그 내부를 진공 말봉하는 스페이서; 상기 두 기판의 대항면 상에 각각 서로 교차하는 방향의 스트라이프 상으로 배치된 음국 및 양국; 상기 음국 및 양국의 교차점에 대응하는 음국 상에 형성된 전자 방출원; 및 상기 메이크로탑으로부터 방출되는 전자를 제어하는 게이트;를 구비한 전계 방출 소자에 있어서, 상기 게이트는 상기 음국 마래의 상기 배면기판 상에 상기 음과 교치하는 방향의 스트라이프 상으로 상기 양곡들에 대응하는 위치에 배치되고, 상기 게이트와 음국 사이에 전기적 절연을 위한 절연층이 형성되며, 상기 전자 방출원은 카본나노튜브와 절연물이 혼합된 페이스트가 도포되어 형성된 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어서, 상기 전자 방출원은 상가 카보나노튜브 및 절연물이 혼합된 페이스트가 상기 음극의 일촉 가장자리의 국소 영역에 일지형으로 도포되어 형성되거나, 혹은 상기 카보나노튜브 및 절연물이 혼합된 페이스트가 상기 음극 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 상기 음극 상에 도포되어 형성된다. 특히, 상기 전자 방출원은 상기 카보나노튜브 및 절연물이 혼합된 페이스트가 상기 음극 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 상기 음극 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 상기 음극에 적어도 한 개 이상의 구멍을 뚫고, 그 구멍이 메워지도록 상기 음극 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 상기 음극 상에 도포되어 형성된이 버림적하다. 이 경우, 상기 구멍들이 3개 이상 복수개 형성될 경우 가운데 위치한 구멍일수록 크게 뚫고 그 가장자리에 카보나노튜브를 도포하여 한 픽셀 대의 방출 전류의 군일도를 높이는 것이 비림적하다.

또한, 본 발명에 있어서, 상기 음극들과 양극들 사이의 공간에 상기 전자 방출원으로 부터 방출되는 전자들이 퍼지는 것을 방지하기 위한 메쉬형 그리드를 더 구비한 것이 바람직하다.

이하 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절연물을 이용한 MIC형 전계 방출 소자를 상세하 게 설명한다.

전 설명한다.

본 출원인의 선 발명에 따른 카본나노튜브를 이용한 삼국구조 전계 방출 소자의 개략적 수직 단면 구조가도 2에 도시되어 있다. 도시된 바와 같은 카본 나노 튜브를 이용한 삼국 구조 전계 방출 소자는 스페이서 (16)를 사이에 두고 일정한 간격을 유지하면서 서로 대형하는 배면 기판(11) 및 전면 기판(20)이 구비되고. 이를 사이에 주고 일정한 간격을 유지하면서 서로 대형하는 배면 기판(11) 및 전면 기판(20)이 구비되고. 이를 사이에 주고 일정한 간격을 유지하면서 서로 대형하는 배면 기판(11) 및 전면 기판(20)이 구비되고. 이를 사이에 주고 왕을원으로 금속 마이크로탑(미도시)이 형성되거나 혹은 카본 나노 튜브(15)가 국소적으로 도포된 음국(12) 및 양국(14)이 구비되며, 음국(12) 하부에 절면총(17)을 사이에 두고 게이트 (13)들이 구비된다. 게이트(13)들은 배면기판(1) 상에 스트라이프 상으로 나라하게 배치되어 있다. 이를 스트라이프 상의 게이트(13)들이 형성된 배면 기판(11) 상에 절연총(17)이 형성되다. 양국(14)들은 음국(12)들과 교차하는 방향의 스트라이프 상으로 서로 나라하게 음국(12)들이 형성된다. 양국(14)들은 음국(12)들과 교차하는 방향의 스트라이프 상)으로 전면기판(20)의 음국 대향면 상에 나라하게 배치된다. 음국(12)들과 게이트(13)들이 교차하는 지점을 음국(12)들과 교차하는 지점의 음국(12)들의 가장자리부에 국소적으로 도포되거나, 게이트(13)들(혹은 양국들)과 교차하는 지점의 음국(12)들에 적어도 한게 이상의 구멍을 뚫고 그 구멍의 가장자리부에 카본나노튜브(15)가 국소적으로 도포되다. 이와 같이 카본나노튜브는 교차점의 음국 상의 어느 부분에도 형성될 수 있으나 굳이 음국의 가장자리부에 형성하는 이유는 실험적으로 가장자리부에서 가장 강한 전계가 형성되어 전자 방출에 가장 유리하기 때문이다. 즉,이 전계 방출 소자는 게이트가 음극(cathode)의 하단에 위치한 이른바 under-sate 구조의 전계 방출 소자이다.

본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 MIC형 전계 방출 소자는 최근에 제안된 소위 'undergate' 구조의 '삼금 전계 방출 소자를 기본 구조로 하며 게이트가 음극의 하단에 위치하도록 하며 전자 방출량의 제어가 용미한 동시에 저 전압 전계 방출 물질인 탄소나노튜브를 전자 방출원으로 음극 성에 형성하기 용이한 구조로 하되, 카본나노튜브와 절면물을 이용하여 물질에 따라 도 3에 도시된 비와 같은 에너지 밴드캡을 갖는 MM (metal=Insulator-metal) 구조와 유시한 후막의 MIC 구조의 전자 방출원을 음극 상에 형성한 것을 특징으로 한다. 이를 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

대 형성한 것을 특성으로 한다. 비를 구제적으로 설명하면 다음과 같다.

도 4a 및 도 4b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노류브와 절면물을 이용한 배(형 전계 방출 소자의 제1실시 에 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도 및 음국 상에 카보나노튜브와 절면물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도이다. 도 4a의 전국 및 카본나노튜브와 절면물 페이스트의 수직 단면은 도 4b의 A-A'라인을 따라 절개한 부분의 단면을 도시한 것이다. 도시된 바와 같이, 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 배면형 전계 방출 소자는 스페이서(160)를 사이에 두고 일정한 간격을 유지하면서 서로 대형하는 배면 기판(110) 및 전면 기판(200)이 구비되고, 이를 사이에 전자 방출원으로 카본나노 튜브가 절면물 분말과 함께 페이스트(150) 상태로 국소적으로 도포된 음국(120) 및 양극(140)이 구비되며, 음극(120)하루에 절면용(170)을 사이에 두고 게이트(130)들이 구비된다. 게이트(130)들은 배면기판(110) 상에 음극(120)들과 교치하는 방향의 스트라이프 상으로 서로 나란하게 형성된다. 양극(140)을은 음극(120)들과 지하는 방향의 스트라이프 상(게이트들에 대응하는 나라는 방향의 스트라이프 상(게이트들에 대용하는 나라는 방향의 스트라이프 상(게이트들에 대용하는 나라는 방향의 스트라이프 상(게이트를에 대용하는 나라는 방향의 스트라이프 상)으로 전략기판(200)의 유극(120)들과 게이트(150)를이 교치하는 지점들의 음극(120)상에는 카본나노 튜브를이 절면물 분말과 함께 페이스트(150)상태로 도포되어 형성된다. 카본나노 튜브가 온험된 절면물 페이스트(150)가 도포되는 경우 그 위치는 도 4a 혹은 도 4b에 도시된 바와 같이 음극(120)들의 가장자라부에 국소적으로 도포된다. 이와 같이, 탄소나노튜브와 유전체 물질을 섞어 페이스트를 만들어 내려한 무화된의 음곡(120)에 입합으로서 음곡판(cathode plate)을 용이하게 제작할수 있다.

도 5a 및 도 5b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절연물을 이용한 MC형 전계 방출 소자의 제2실시에 구조를 개략적으로 보여주는 수작 단면도 및 음극 상에 카본나노튜브와 절연물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도이다. 도 5a의 전국 및 카본나노튜브와 절연물 페이스트의 수작 단면은 도 5b의 8-8' 라인을 따라 절개한 부분의 단면을 도시한 것이다. 도시된 바와 같이, 제2실시에의 구조는 제이트(130)들(혹은 양극들)과 교치하는 영역의 음극(120)들 상에 카본나노튜브와 절연체 분말이 혼합된 페이스트(151)가 도포된 것이 특징이다.

도 6a 및 도 6b는 각각 본 발명에 따른 탄소나노류보와 절면물을 이용한 MIC형 전계 방출 소자의 제3실시에 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도 및 음극 상에 가본나노튜보와 절면물의 페이스트가 도포되는 위치를 나타내는 개략적 평면도이다. 도 6a의 전국 및 카본나노튜보와 절면물 페이스트의 수직 단면은 도 6b의 C-C 라인을 따라 절개한 부분의 단면을 도시한 것이다. 도시된 바와 같이, 제3실시에는 게이트 6b의 C-C 라인을 따라 절개한 부분의 단면을 도시한 것이다. 도시된 바와 같이, 제3실시에는 게이트 (130)들(혹은 양극들)과 교치하는 영역의 음극(121)들에 적어도 한 개 이상의 구멍(1216)을 뚫고 기 구멍 (1216)이 메워지도록 카본나노튜보와 절면물의 페이스트(152)가 도포된 것이 특징이다. 음극(121)에 다양한 모양의 구멍(bote)(121a)을 형성하면 기장자리 방출(edge emission) 영역을 많이 확보할 수 있다. 여기서, 구멍(121a)들이 3개 이상 복수개 형성될 경우 가운데 위치한 구멍일수록 크게 뚫어 한 픽셀 내의 방출 전류의 균일도를 높이는 것이 바람직하다.

이상 제1,2,3실시예에서와 같이 카본나노튜브는 교치점의 음극 상의 어느 부분에도 형성될 수 있으나 굳이 제1실시예와 같이 음극의 가장자리부에 도포하거나, 제3실시예와 같이 음극에 구멍을 뚫어 그 위에 도포하는 이유는 실험적으로 가장자리부 및 구멍의 가장자리부의 예리한 부분에서 가장 강한 전계가 형성되어 전자 방출에 가장 유리하기 때문이다.

도 7은 본 발명에 따른 탄소나노튜브와 절면물을 이용한 MIC형 전계 방출 소자의 제4실시에 구조를 개략적으로 보여주는 수직 단면도이다. 도시된 바와 같이, 제4실시에는 가장자리 방출(edge emission)에 의한 방출전자의 퍼짐을 제어할 수 있도록 음극(121)과 양극(140) 사이에 메쉬(mesh) 형태의 그리드(grid)(180)를 삽입한 것이 특징이다. 이와 같이 메쉬 형태의 그리드(180)를 설치하며 방출 전자의 퍼짐을 방지하면 색분리도가 향상될 수 있다. 이 메쉬 그리드(mesh-grid)(180)는 고휘도를 얻기 위해 양극(140)에 높은 전압을 인가하는 경우에 양극(140)의 전계가 음극(121)에 영향을 주는 문제를 해결할 수 있다.

이와 같은 실시예들의 under-sate의 구조를 제작하는 순서를 살펴보면, 게이트를 기판에 형성한 다음 절 면총을 올리고 절면총위에 음극들을 형성하고, 음극들을 따라 또는 음극들과 게이트들이 겹치는 도트 (dot) 영역에 전자방출원인 키본나노튜브와 유전체의 합성된 물질을 입힌 다음; 기준의 방법으로 스페이 서(160)를 이용하며 전면기판(200)과 배면기판(100)를 진공 밀봉한다.

.미렇게 제작된 전계 방출 소지의 동작원리를 알아보면 다음과 같다.

양극(anode)에 음극에서 다이오드 모드(diode mode)의 전자방출이 되지 않을 정도의 전압을 인가한 상태에서, 게이트에 전압을 인기하면 게이트 인가 전압에 의한 전기장이 절면충을 투고하여 음극의 가장자리 (edge) 부분에 강장 전기장이 형성되게 된다. 도트(dot) 영역에 구멍(hole)이 형성되어 있을 경우에는 그구멍(hole)들 주위의 가장자리 부분에도 강한 전기장에 형성되게 된다. 이 강한 전기장에 의해 MIC 구조의 전자 방출원은 전도체인 탄소나노튜브와 절면체인 유전체 사이에 터널링(tunneling)에 의한 ballistic transport로 전자들이 음극에서 MIC 전자방출원의 표면 밖으로 방출되고 이후 영극 전압에 의해 방출전자들이 양극 쪽으로 끌려가서 양극 표면에 도포된 형광체(미도사)를 여기시켜 발광을 하게 된다.

#84 **5**4

이상 설명한 비와 같이, 본 발명에 따른 카본나노튜브와 절연물질을 이용한 배명 전계 방출 소자는 게이 트가 음극(cathode)의 하단에 위치한 이른바 'under-sate'구조에 카본나노튜브와 절연물을 혼합한 페이스 트를 음극상에 도포하여 카본나노튜브의 전자 방출원을 형성한 구조를 갖는다. 따라서, 소자의 제작 공정 이 단순하여 제작이 용이하고, 이를 대면적의 평판 디스플레이 소자로의 확장이 수월하다.

또한, 카본나노튜브와 절연물 페이스트가 도포되는 음국 영역에 구멍을 형성하며 상기 페이스트를 도포하며 카본나노튜브 전자 방출원을 형성한 경우에는 가장자리 전계가 더욱 강화되므로 더욱 낮은 전압으로 구동되는 저전압 전계 방출 소자의 제작이 가능하다.

더욱이, 메쉬 그리드(mesh-grid)를 음극과 양극 사이에 채용하게 되면 가장자리 방출(edge emission)에 방출전자의 채점을 방지할 수 있어 색분리도를 향상시킬 수 있고, 양극에 고전압을 인기하면 고회도의 동작이 가능하게 된다.

(57) 원구의 범위

청구항 1

일정한 간격으로 서로 대항하도록 배치된 배면 기관 및 전면 기관;

상기 두 기판의 간격을 유지하면서 그 내부를 진공 밀봉하는 스페이서;

장기 두 기판의 대항면 상에 각각 서로 교차하는 방향의 스트라이프 상으로 배치된 음극 및 음극》

상기 음극 및 양극의 교차점에 대응하는 음극 상에 형성된 전자 방출원, 및

상기 마이크로팁으로부터 방출되는 전자를 제어하는 게이트를 구비한 전계 방출 소자에 있어서,

성기 게이트는 장기 음극 이래의 장기 배면기관 상에 상기 음극과 교치하는 방향의 스트라이프 상으로 상 기 양극들에 대응하는 위치에 배치되고, 상기 게이트와 음극 사이에 전기적 절면을 위한 절연총이 형성되 며, 상기 전자 방출원은 카본나노튜브와 절연물이 혼합된 페이스트가 도포되어 형성된 것을 특징으로 하 는 카몬나노튜브 및 절면물질을 이용한 세 C형 전계 방출 소자

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 전자 방출원은 상기 카보나노튜브 및 절면률이 혼합된 페이스트가 상기 음극의 일촉 가장자리의 국 소 영역에 일자형으로 도포되어 형성된 것을 특징으로 하는 카보나노튜브 및 절면물질을 이용한 베0형 전 제 방출 소자:

청구항 3

제1항에 있어서,

'상기 전자 방출원은 '상기 카본나노류브 및 절면물이 혼합된 페이스트가 상기 음국 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 '상기 음국 상에 도포되어 형성된 것을 특징으로 하는 카본나노튜브 및 절면물질을 이용한 배(형 전계 방출 소자.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기, 전자, 방출원은 '상기' 카본나노튜브 및 '절면물이 혼합된 테이스트가 상기 음국 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 '상기' 음국에 적어도 한 개' 이상의 규명을 뚫고, 그 규명이 메워지도록 상기' 음국 및 게이트의 교차 영역에 대응하는 상기 음국 장에 도포되어 형성된 것을 특징으로 하는 카본나노튜브 및 절연물질을 이용한 세(형 전계 방출 소자:

청구항 5

제4항에 있어서,

성기 구멍들이 3개 이상 복수개 형성될 경우 가운데 위치한 구멍일수록 크게 뚫고 그 가장자리에 카보나 노튜브를 도포하며 한 픽셀 내의 방출 전류의 군일도를 높이는 것을 특징으로 하는 카보나노튜브 및 절면 물질을 이용한 배(형 전계 방출 소자)

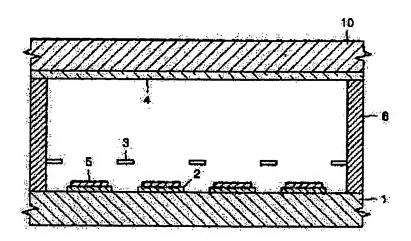
청구항 6

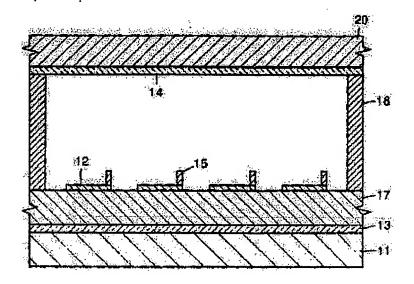
제1항 내지 제5항 중 마느 한 항에 있어서,

·상기, 음국들과, 양국들, 사미의, 공간에, 상기, 전자, 방출원으로, 부터, 방출되는, 전자들이, 퍼지는, 것을, 방지하기, 위한, 메쉬형, 그리도를, 더, 구비한, 것을, 특징으로 하는, 카본나노류브, 및 절연물질을, 이용한 제(형, 전계방을 소자.

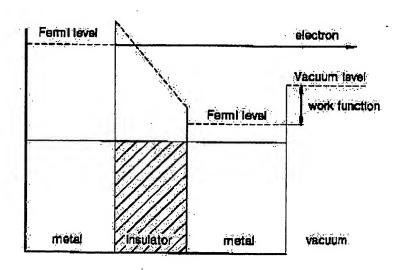
<u> SP</u>

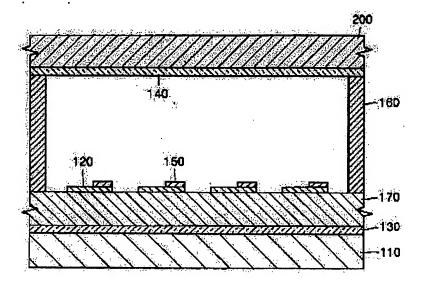
도만1



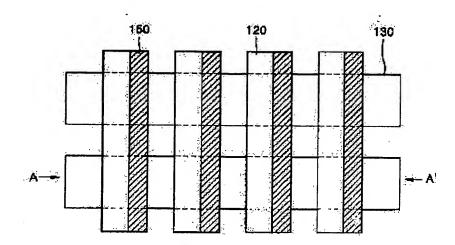


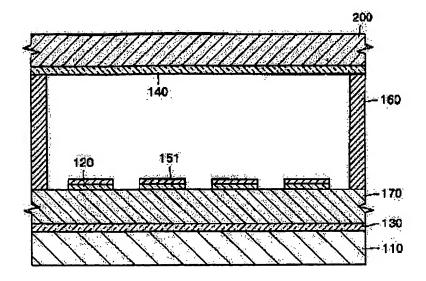
⊊B/3



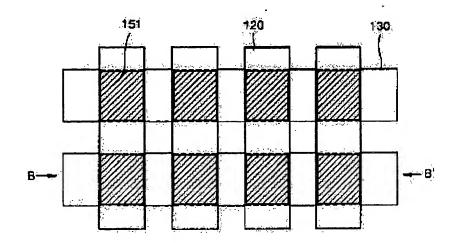


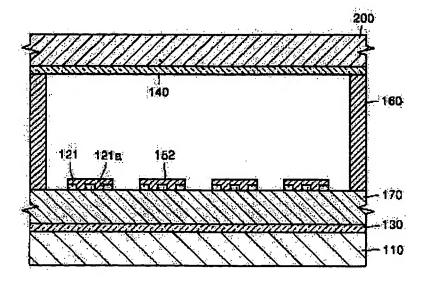
⊊B4b



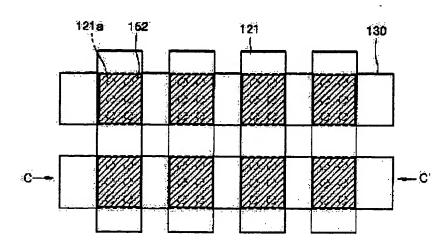


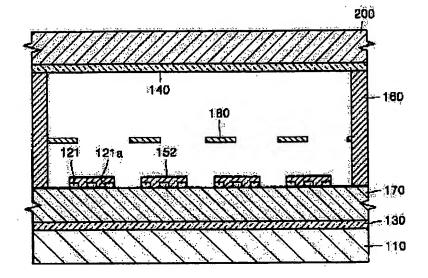
*⊊95*b





⊊£!6b





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	TADED TEXT OR DRAWING
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.